

技術講習会

分光エリプソメーター(屈折率・膜厚測定装置)

地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センターでは、所有している試験研究機器等を用いて、企業の皆様の新技術・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用可能範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用いただくため、下記の要領で講習会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時：① 令和4年9月7日(水) 9:45～11:45
② 令和4年9月7日(水) 13:15～15:15

※①～②とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選びください。

(バスでお越しの場合、①は9:27に、②は13:01に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45～13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)
当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の10分前より始めます。)

◆定 員：各コース(①～②)とも1社のみ。参加人数は1社2名まで

※受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆費 用：無料

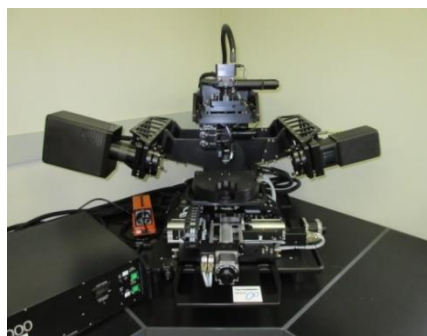
◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※お申込みは、メール (izumi-entry@orist.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願います。

◆対象機器：分光エリプソメーター (M-2000UI)

H29年度JKA機械設備拡充補助事業により導入しました分光エリプソメーター(M-2000UI)を用いた初心者向けの講習を開催します。分光エリプソメーターは、非破壊で屈折率や薄膜の膜厚などを測定できる装置です。

本講習では、エリプソメーターの原理を説明した後、機器の概要説明を行います。その後、実習用試料の屈折率や膜厚等を測定することにより、装置の操作方法を説明します。



機器型番：M-2000UI

ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社

◆持ち込み試料について：本講習会では、受講者による持ち込み試料の対応はいたしません。

◆講習担当：

(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 電子・機械システム研究部 (佐藤 和郎)

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2512

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策へのご協力をお願い】

研究所内ではマスクを常時着用し、入口に設置している消毒剤で手指消毒をお願いします。また、受付時に健康状態を確認させていただきます。

